

小型高真空排気装置

High Vacuum Pumping System

VFR-200M/X

概要

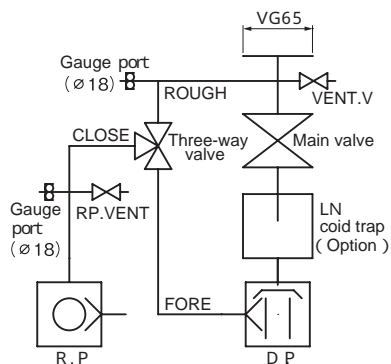
VPCシリーズのデザインと機能を一新しました。
安全性が向上しました。

特長

1. 新型バルブの採用により、信頼性が向上しました。
2. 真空系等のオプションが組込める新型架台により、装置の拡張性が向上しました。
3. 電気配線を中心とした装置の安全性がさらに向上しました。
4. 空冷型で冷却水を使いません。

排気系統図

VFR-200M/X



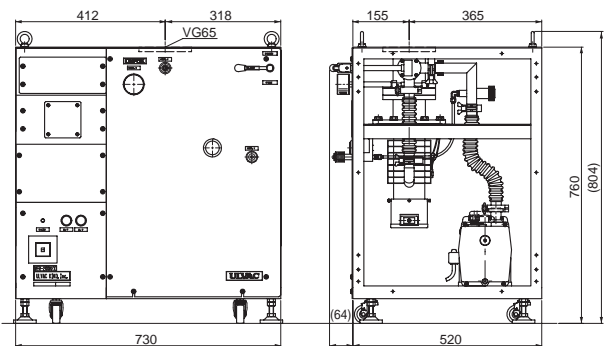
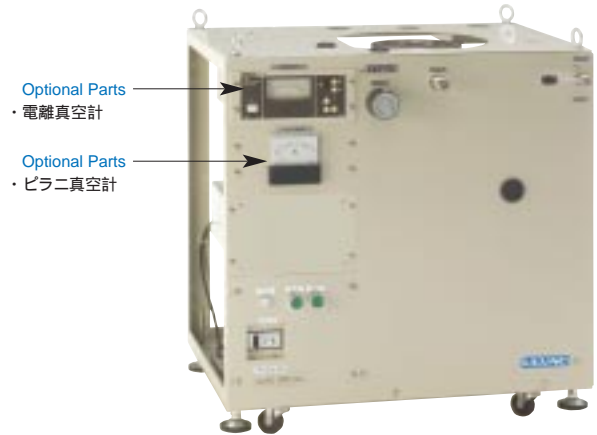
High Vacuum Pumping System

小型高真空排気装置

(空冷型)

VFR-200M/X

RoHS対応



仕様 Specifications

到達圧力 Ultimate pressure	10 ⁻⁴ Pa台 (10 ⁻⁵ Pa台 液体窒素使用時)
メインポンプ Main pump	油拡散ポンプ 200L/sec
補助ポンプ Back pump	油回転真空ポンプ 100L/min
吸気口 Suction port	VG-65
メインバルブ Main valve	65A バタフライバルブ
補助バルブ Back valve	三方向バルブ
所要電力 Power required	1 100V 1.4kVA
質量 Weight	120kg
外径寸法 (幅)×(奥行)×(高) Dimensions (W)×(D)×(H)	730mm × 584mm × 804mm

オプションパーツ Optional parts

ピラニ真空計	
電離真空計	

写真のOptional partsは標準装備していません。